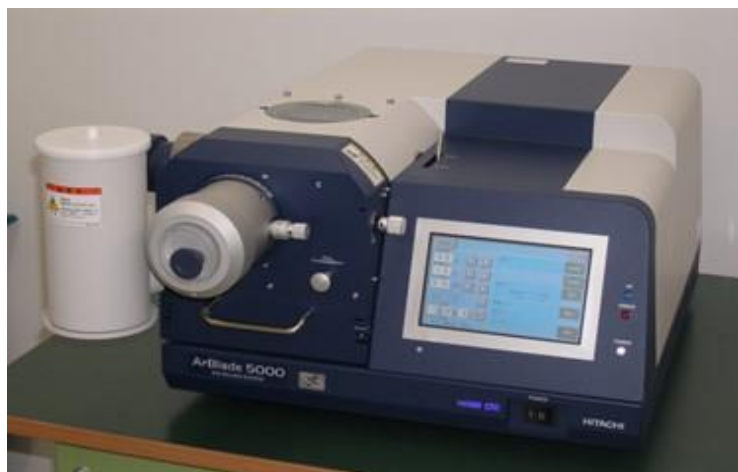


◇ 2024年9月、当社分析センターにイオンミリング装置が導入されました。イオンミリング装置は、シートの断面を加工する装置で、加工時の応力が小さく、非常に清浄な面に加工することができます。また、清浄な加工により金属の結晶粒の観察も可能です。

装置 <株式会社日立ハイテク製 ArBlade5000>



主な機能

○ハイスループット

1mm/hrの加工速度

(Si基板加工時・・・メーカー測定値)

○冷却機能

熱ダメージを低減

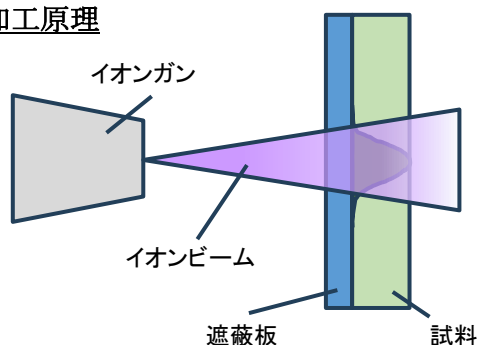
○広幅加工

加工幅 ～8mm

○平面ミリング機能

機械研磨後の最終仕上げ加工

☆加工原理



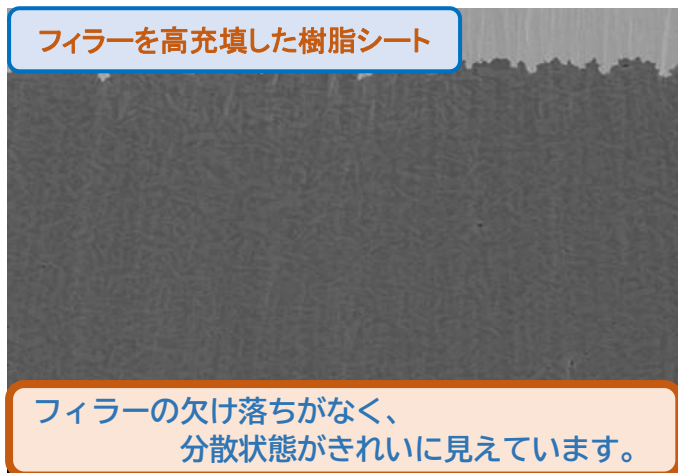
Arイオンを試料に照射し、物理的なダメージを抑えながら、清浄な断面加工ができる。

物理的なダメージが小さいため、フィラー等の欠け落ちや柔らかい樹脂のダレが発生しにくい。

金属の結晶粒の観察も可能。

☆加工例

フィラーを高充填した樹脂シート



フィラーの欠け落ちがなく、
分散状態がきれいに見えています。

金属箔



結晶粒が成長している様子が
観察できています。